研究評価委員会

「次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発」（中間評価）分科会

日時：２０２４年6月１８日（火）１０：００～１６：２５

場所：ステーションコンファレンス川崎 Ａ～Ｃ会議室（オンラインあり）

議事次第

（公開セッション）

１．開会	10:00～10:05	（5 分）
２．分科会の設置について	10:05～10:20	（15 分）
３．分科会の公開について		－
４．評価の実施方法について		－
５．プロジェクトの説明		
5.1 プロジェクトの説明	10:20～10:55	（35 分）
・意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋		
・目標及び達成状況（概要）		
・マネジメント		
5.2 プロジェクトの詳細説明	10:55～11:30	（35 分）
・目標及び達成状況（詳細）		
5.3 質疑応答	11:30～12:10	（40 分）
休憩（昼食）	12:10～13:10	（60 分）

（非公開セッション）

６．プロジェクトの補足説明		
6.1 製造プロセス支援用計算機システムおよび高信頼性メカニズム等解析技術の開発 ［説明 25 分、質疑応答 15 分］	13:10～13:50	（40 分）
6.2 計算機支援に向けた製造プロセスの可視化技術及びメカニズム解析技術および次世代製造プロセス技術の開発 ［説明 25 分、質疑応答 15 分］	13:50～14:30	（40 分）
6.3 製品適用に向けたプロセス技術の開発 ［説明 25 分、質疑応答 15 分］	14:30～15:10	（40 分）
７．全体を通しての質疑	15:10～15:50	（40 分）
休憩	15:50～16:00	（10 分）

（公開セッション）

８．まとめ・講評	16:00～16:20	（20 分）
９．今後の予定	16:20～16:25	（5 分）
10. 閉会	16:25	